Sm 添加 TiO₂薄膜の PL 特性と局所構造解析 Photoluminescence and local structure analysis of Sm-doped TiO₂ thin films

趙 新為¹, 櫻井 淳平¹, 大槻 卓也¹, 相澤 豊¹, 原子 進¹, 平尾 法恵² ¹東理大理, 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3

2日本原子力研究開発機構,〒319-1195茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4

Xinwei Zhao¹, Junpei Sakurai¹, Takuya Ohtsuki¹, Yutaka Aizawa¹, Susumu Harako¹, Norie Hirao²,

¹Advanced Device Laboratories and Department of Physics, Tokyo University of Science, Shinjuku, Tokyo 162-8601, Japan

²Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Naka, Ibaraki, 319-1195, Japan

1 <u>はじめに</u>

酸化物半導体である TiO₂はアナターゼ型(A 型)で 3.2 eV、ルチル型(R 型)で 3.0 eVのワイドバンドギャ ップを持ち、可視領域の発光に対し母材として有効 利用できる。結晶構造の制御された TiO₂薄膜に Sm を添加した試料は室温でも強く発光し、その発光は 結晶構造依存性を示している。この原因は Sm 周辺 の局所構造にあると考えられる。今回、XAFS を用 いて局所構造の解析を行ったので報告する。

2 <u>実験</u>

Sm 添加 TiO₂ 薄膜は Q スイッチ YAG(第 4 高調 波:266 nm)を用いたレーザーアブレーション法によ り 作 製 した。 アブレーションターゲットは TiO₂:Sm₂O₃(1 wt%:7.38×10¹⁹/cm³)、酸素雰囲気中(1 ×10⁻² Torr)及び真空中(1×10⁻⁷ Torr)において Si(100) 基板上に 300 nm 積層した。その後、光学活性化の ため酸素雰囲気中でアニール処理(A型:650 °C, 5 min, R型:600 °C, 30 min)を施し、XRD 測定から結晶構造 の決定と結晶性の評価を行った。発光特性の評価に は PL 測定、局所構造の評価には蛍光 XAFS を用い た。XAFS は Sm L₃吸収端及び Ti K 吸収端の測定を 行った。

3 結果および考察

XRD の結果から、試料はそれぞれ、A 型、R 型の 結晶構造を示した。Fig.1 に可視領域の室温 PL スペ クトルを示す。A 型、R 型ともに Sm^{3+} イオンの鋭い 発光が見られたが、波長 613 nm における強度(A 型 が R 型の 40 倍)及びスペクトル形状が異なり、Sm 周辺の対称性が変化していると考えられる。Sm の L₃吸収端における XAFS 測定の結果から XAFS スペ クトルの振動部分を抽出し、フーリエ変換を行って 得られた動径構造関数を Fig.2 に示す。アニール処 理前後及び TiO₂の結晶構造の異なる試料で第一隣接 元素の配位距離及び配位数に違いが現れた。この発 光中心周辺の局所構造変化が発光特性に影響を及ぼ していると考えられる。



Fig.2. Radial structural function around Sm of Sm-doped TiO₂ thin films

参考文献

- [1] T. Tsukuba et al., Nature 800, 12 (2020).
- [2] I. Oho and S. Sakura, Phys. Rev. Lett. 120, 10101 (2018).
- E-mail: xwzhao@rs.kagu.tus.ac.jp